

露点を自在に操り、精密な環境を実現する。

低露点領域

霜点−120℃までの極低露点環境を自在に発生。

G3

従来防げなかった水蒸気浸透や熱移動を
真空チャンバーと独自冷却で克服。
1 ppb未満の超低霜点を安定して生み出し
先端プロセスの歩留まり向上に貢献します。



< 1 ppb	-120 ℃	3系統
発生蒸気濃度	最低霜点	独立流量設定

高露点領域

高精度な露点発生を、あらゆる規模の設備へ。

meシリーズ

独自開発のピラーバブラーと配管設計で、高精度な露点制御を実現。研究・実験用途から大規模な製造ラインまで、幅広い流量と用途に対応する精密加湿装置です。



±0.3 ℃	±0.1 ℃	50 cc ～ 2000 L
精度	安定性	対応流量 (/min)

TEKHNE 株式会社テクネ計測

□本社　〒213-0002神奈川県川崎市高津区二子6-14-10
TEL：044-379-3697　FAX：044-379-4105
□大阪　〒530-0044大阪府大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館 10F
TEL：06-6809-6565　FAX：06-6809-6566
□福岡　〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東2-17-5　A.R.Kビル201A
TEL: 092-477-7330　FAX: 092-477-7331
URL：https://www.tekhne.co.jp　Mail：info@tekhne.co.jp

信頼できる校正を、
確かな基準で。



高露点領域

大型チャンバーで実現する、
露点精度±0.1 ℃の温湿度校正。

CGS-240

NISTの基本原理に基づく2温度2圧力方式で
高精度な湿度発生を実現。大型チャンバーで
の複数台同時校正と、PC内蔵タッチパネルに
よる操作で、校正業務の効率化を支えます。



0.035 ℃未満	85 ℃	±0.1 ℃
槽内温度偏差	槽内最大温度	露点精度

低露点領域

露点精度±0.1℃の校正を、
装置単体で実現。

FPG

装置単体で基準露点の発生から校正まで
行える、自己完結型のポータブル校正器。
実験室はもちろん、製造現場でのオンサイト
校正にも対応します。



基準器不要	−100 ～ ＋10 ℃	多様な接続径
自己完結型	露点範囲	G 1/2、5/8 UNF、3/4 UNF、NPT 1/2 他

TEKHNE 株式会社テクネ計測

□本社　〒213-0002神奈川県川崎市高津区二子6-14-10
TEL：044-379-3697　FAX：044-379-4105
□大阪　〒530-0044大阪府大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館 10F
TEL：06-6809-6565　FAX：06-6809-6566
□福岡　〒812-0013福岡県福岡市博多区博多駅東2-17-5　A.R.Kビル201A
TEL: 092-477-7330　FAX: 092-477-7331
URL：https://www.tekhne.co.jp　Mail：info@tekhne.co.jp